

Olympus LCPLN100XIR 100X NIR-Objektiv

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus LCPLN100XIR 100X NIR Objective

Produkt #90-484 **NEU** 1 In Stock

1 €12.200⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€12.200,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

LCPLN100XIR **Modellnummer:**

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm

Microscope Objective **Typ:**

Infinity Corrected **Art:**

Olympus Hersteller:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

0.22 Bildfeld (mm):

43.80 Länge ohne Gewinde (mm):

31.00 Max. Durchmesser (mm):

184 Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
Glass: 0 - 0.7mm
Silicon: 0 - 1.0mm

1.80 Brennweite BW (mm):

100X Vergrößerung:

0.85 Numerische Apertur NA:

0.39 Auflösung (μm):

0.38 Tiefenschärfe (μm):

Arbeitsabstand (mm):
Glass: 1.20 - 0.90mm
Silicon: 1.20 - 1.05mm

400 - 1600 Wellenlängenbereich (nm):

22 Feldzahl:

45 Parfokallänge (mm):

N/A Immersionsflüssigkeit:

3.06 Entrance Pupil Diameter (mm):

Gewinde & Montage

RMS / 20.32mm x 36 TPI Gewinde:

Konformität mit Standards

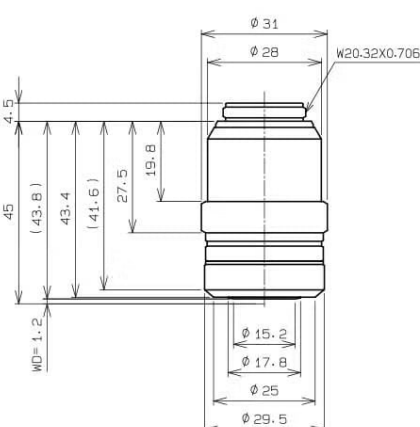
Anzeigen Konformitätszertifikat:

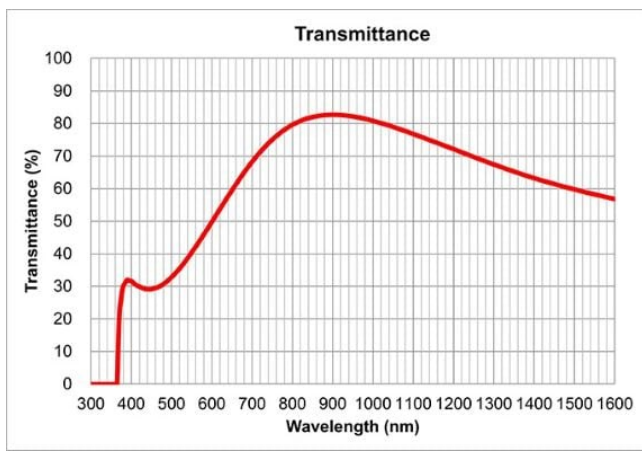
Produktdetails

- Lange Arbeitsabstände reduzieren das Risiko, die Proben zu beschädigen
- Korrekturing zur Anpassung an die Probendicke
- Ideal für die Inspektion von Siliziumwafern

Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich bieten eine hohe Transmission zwischen 700 und 1600 nm, was sie in Verbindung mit einer NIR-Tubuslinse zu einer hervorragenden Wahl für die Nahinfrarot-Mikroskopie macht. Diese Objektive zeichnen sich durch große Arbeitsabstände aus, was das Risiko, Proben zu beschädigen, verringert. Sie unterstützen Beobachtungen bis zur Sehfeldzahl 22. Vergrößerungen von 20X und höher verfügen über einen Korrekturing, um Aberrationen in Abhängigkeit von der Dicke des zu prüfenden Glas- oder Siliziumsubstrats zu korrigieren. Olympus plan-achromatische Objektive für den Nahinfrarotbereich sind ideal für die Inspektion von Silizium-Wafern geeignet, um die innere Struktur auf Defekte zu untersuchen.

Technische Informationen





LCPLN100XIR Transmission Graph

;